株式会社テクノミュー

TFL2100
回転型
シリーズ

非接触平面度測定機

new

写真は特注機

低価格

回転軸エアースピンドル

ベースに石定盤使用

重量物の測定に対応

特長

- 低価格にて高精度な測定を実現
- データ収集が高速
- 非接触なので検査対象を傷つける心配がありません
- 測定対象物による影響が非常に少ない
- 重量物の測定が可能
- 驚異的な面振れ精度を実現
- ご使用の対象物形状に合わせてシステム構築が可能
  （ご相談下さい）

用途

- 樹脂の加工板やガラス基板の平面度測定
- ステンレスやチタン、アルミ、鉄板などの金属板の
  平面度測定
- また、金型などの重量物の平面度測定

・仕様　（写真の特注機）

項　目		仕　様
基準距離		10mm
Z軸方向測定範囲		±1mm
測定方式		三角測距式
光　源	レーザ	半導体レーザ
	波長	650nm　可視光ＣＬＡＳ1
	出力	0.3mW
繰り返し測定精度		0.01μm　(注1)
センサ部移動量	Z軸ステージ（手動、固定式）	±45mm
ＸＹ軸部	移動量	X=380mm(MAX)　Y=400mm(MAX)
	最小送り量	2μm/STEP
	最高移動速度	100mm/SEC
	位置決め精度	10μm以内
	繰り返し位置決め精度	±2μm以内
	ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ･ﾛｽﾄﾓｰｼｮﾝ	5μm以内
θ軸部	回転量	360°
	最小送り量	0.0036/STEP
	最高回転速度	10rpm　(測定速度)
	テーブル面	φ600 (ワークφ800迄搭載可能)
	耐荷重	200Kg
	位置決め精度	10μm以内
	繰り返し振れ精度	5μm以下(Φ600円周上)
制御部	パソコン	ＰＣ／ＡＴ互換機
	ステージドライバ	5相マイクロステップドライバ
	アナログ部	
	ＵＳＢI／Ｆ	USB1.1/2.0
	外形･重量	約　W433×H140×D255　　7Kg以下
データ処理	測定データ量	5000データ/回転×20(MAX)
ＰＣソフトウェア	平面度測定専用プログラム	ＯＳ　Windows2000,XP,7対応

(注1) レーザセンサの単体精度です。またレーザセンサは変更することが可能です。(但しステージ部に搭載可能であること)

この仕様以外に、測定したいワークの形状や、小さいものから大きいものまで対応可能ですのでご相談ください。

仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

非接触測定機の専門メーカー

株式会社テクノミュー

〒359‐0021　埼玉県所沢市東所沢 2‐54‐17

計測システム部　　TEL：04‐2945‐1483　FAX：04‐2945‐9541

E-mail：tm_info@technomu.co.jp　　URL：http://www.technomu.co.jp